

Plateforme de caractérisation

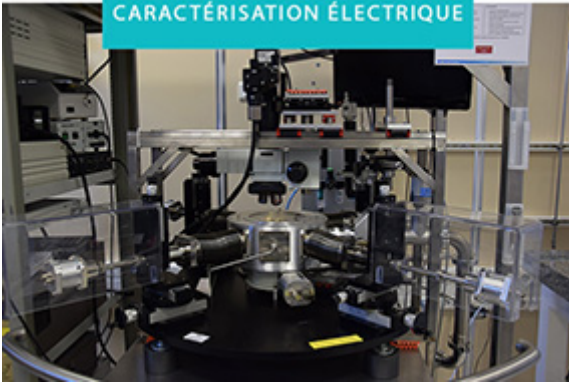


- Microscope électronique à balayage - SEM (Scanning Electron Microscopy) / EDX (Energy Dispersive X-ray spectrometry)
- Microscope électronique double faisceau - FIB (Focused Ion Beam) / STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) / EDX (Energy Dispersive X-ray spectrometry)
- Microscopes optiques



- Microscope à force atomique - AFM (Atomic Force Microscopy) en mode tapping et modes électriques
- Diffractomètres à rayon X
- Appareil de mesure effet HALL
- Spectromètre FTIR (Fourier Transform InfraRed spectroscopy)
- Mercury probe
- Mesure 4 pointes - mesure de la résistivité
- Mesure de la tension superficielle par angle de goutte
- Granulomètre
- Profilomètre optique
- Vibromètre laser à effet Doppler

CARACTÉRISATION ÉLECTRIQUE



- Station sous pointe - mesures I(V), C(V), impédance, tests destructifs CVS/LRVS (Linear Ramped Voltage Stress), RF
- Testeur ESD (ElectroStatic Discharge)
- Spectroscopie des niveaux profonds - DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy)
- Station sous pointe cryogénique

FOUR



- Four à recuit rapide (RTA)
- Four de diffusion et recuit META

CHIMIE



- Hotte solvant - Lay Concept
- Hotte de gravure électrochimique SiPoreux

- Hotte de gravure